PATENT COOPERATION TREATY

PCT

REC'D	2 5	OCT	2004
WIPO			PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

App	licantic	oroge	antia fila reference	T		
Applicant's or agent's file reference P60144PCT		FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)		ation of Transmittal of International Examination Report (Form PCT/IPEA/416)		
				International filing date 02.07.2003	(day/month/year)	Priority date (day/month/year) 12.07.2002
	nation 5D21/		ent Classification (IPC) or t	both national classification	and IPC	
,	icant DTEC	H DE	EUTSCHLAND GMBI	H et al.		
1.	This Auth	intern nority	national preliminary exa and is transmitted to the	amination report has been applicant according to	en prepared by this la Article 36.	nternational Preliminary Examining
2.	This	REP	ORT consists of a total	of 5 sheets, including t	his cover sheet.	
		וסטט	i aniichaca ana ale me	anied by ANNEXES, i.e. basis for this report and n 607 of the Administra	7/01 shoots containin	ption, claims and/or drawings which have g rectifications made before this Authority
	The		nexes consist of a total		uve mandonoma uma	er the POT).
3.	This	repor	t contains indications re	elating to the following it	tems:	
	i	\boxtimes	Basis of the opinion			
	П		Priority			
	Ш		Non-establishment of	opinion with regard to r	ovelty, inventive ste	p and industrial applicability
	IV		Lack of unity of invent	tion	•	, promise and the second of th
	V	⊠ —	Reasoned statement citations and explanat	under Rule 66.2(a)(ii) w tions supporting such st	ith regard to novelty, atement	inventive step or industrial applicability;
	VI		Certain documents cit			
	VII			international application		
	VIII Certain observations on the international application					
Date	Date of submission of the demand				Date of completion of	f this report
10.1	10.11.2003				22.10.2004	
Name	and r	nailing exami	address of the internation	nal	Authorized Officer	
	preliminary examining authority: European Patent Office D-80298 Munich Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465			556 epmu d	Mizera, E Telephone No. +49 8	9 2399-8580

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP 03/07051

I. Basis of the	re	D	orl	t
-----------------	----	---	-----	---

1. With regard to the **elements** of the international application (Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rules 70.16 and 70.17)):

	Des	scription, Pages	
	1-1	8	as originally filed
	Cla	ims, Numbers	
	1-1	0	filed with telefax on 18.10.2004
	Dra	wings, Sheets	
	1/4-	4/4	as originally filed
2.	Witi lanç	h regard to the langu guage in which the int	age, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the ternational application was filed, unless otherwise indicated under this item.
	The	se elements were av	ailable or furnished to this Authority in the following language: , which is:
		the language of a tra	anslation furnished for the purposes of the international search (under Rule 23.1(b)).
			lication of the international application (under Rule 48.3(b)).
		the language of a tra Rule 55.2 and/or 55.	anslation furnished for the purposes of international preliminary examination (under 3).
3.	With inte	n regard to any nucle rnational preliminary (ectide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the examination was carried out on the basis of the sequence listing:
		contained in the inte	rnational application in written form.
		filed together with the	e international application in computer readable form.
		furnished subsequer	ntly to this Authority in written form.
		furnished subsequer	ntly to this Authority in computer readable form.
		The statement that the international a	he subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure pplication as filed has been furnished.
٠		The statement that the listing has been furnitude.	he information recorded in computer readable form is identical to the written sequence ished.
4.	The	amendments have re	esulted in the cancellation of:
		the description,	pages:
		the claims,	Nos.:
		the drawings,	sheets:

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP 03/07051

5 🗆	This report has been established as if (some of) the amendments had not been made	
· —	This report has been established as it (some of) the amendments had not been made	, since they have
	been considered to go beyond the disclosure as filed (Rule 70.2(c)).	•
	5 ,	

(Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.)

6. Additional observations, if necessary:

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statement

Novelty (N)

Yes: Claims No:

1-10

Inventive step (IS)

Yes: Claims

Claims

1-10

Industrial applicability (IA)

Claims

1-10

Yes: Claims No: Claims

2. Citations and explanations

see separate sheet

EXAMINATION REPORT - SEPARATE SHEET

AS TO BOX V:

1. The following documents are cited:

D1: US-B-6 261 4331 (LANDAU UZIEL) 17 July 2001 (2001-07-17)

D2: GB 871 203 A (ARTUR RIEDEL; FRANZ BACHMANN) 21 June 1961 (1961-

06-21)

- Both cited documents disclose devices for monitoring electrolytic processes, 2. comprising anode, cathode and a reference electrode. When a reference electrode is used, it goes without saying that the voltage between this electrode and the respective electrode to be monitored is detected by a voltmeter. Reference is made to the drawings contained in these documents.
- 4. With respect to both of D1 and D2 claims 1 and 6 differ by the presence of two reference electrodes being disposed at the surface of the anode, respectively cathode. This feature establishes novelty of these claims over D1 and D2.
- Embodiments applying two reference electrodes are well known in the prior art. In 5. this context reference is made to document D4=JP8188896, introduced during the PCT procedure. The relevant disclosure is contained in Fig.4 of this document.
- With respect to this disclosure claims 1 and 6 differ by the nature of the cathode, 6. which is a wafer or a chip carrier substrate, whereas D4 discloses an electrorefining method. Moreover the two reference electrodes are not disposed at the surfaces of the electrodes of different polarity.
- For this reason claims 1 and 6 are novel also with regard to D4. These claims and 7. claims 2-5 and 7-10, which depend on these claims, meet the requirements of Art.33(2) PCT.
- The provision of two reference electrodes at the surface of the anode and of the 8. cathode allows an exact control of the potential of both electrodes. In D4 the reference electrodes are not disposed in this manner, so that the desired precision will not be obtained. The formation of metal voids in the deposited structures can thus be effectively prevented. Moreover D4 does not refer to a cathode which is a wafer of a chip carrier.

claims 2-5 and 7-10.

- For these reasons none of D1, D2 and D4 renders the teaching of independent 9. claims 1 and 6 obvious. The existence of an inventive step, required under Art.33(3) PCT can therefore be acknowledged. This applies also to dependent
- 10. The description has not yet been adapted to the newly filed claims. For this reason claims 1-10 are not fully supported by the description, which is objectionable under Art.6 PCT.

Enclosure



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-188896

(43)公開日 平成8年(1996)7月23日

					
(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	庁内整理番号	FΙ	
C 2 5 C	1/00	301 Z		-	技術表示箇所
	7/02	302 D			
G01N	27/00	Z			

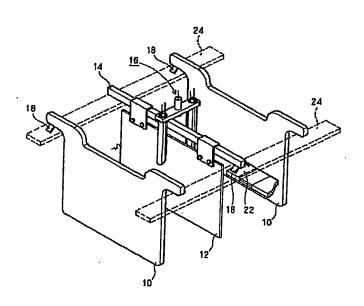
	i求 請求項の数5 FD (全 7 頁)
(21) 出願番号 特願平7-16507 (71) 出願人 00018	83303
(72)発明者 安藤 愛媛! (72)発明者 土田 愛媛! (72)発明者 土田	金属鉱山株式会社 都港区新橋5丁目11番3号 孝治 県新居浜市王子町3-531 直行 県新居浜市星越町10-9 廣志 県新居浜市中西町10-12 士 田中 増顕

(54) 【発明の名称】 電解精製法および該電解精製法で用いる測定装置

(57)【要約】

【目的】 電解精製を行うにあたり、カソードの装入位置のずれを検出し、その検出に基づいて調整作業を容易に行うことができる電解精製法を提供する。また、電解精製を行う際、複数のカソードのそれぞれのアノードに面した2つの面に流れる電流値を容易に測定できる測定装置を提供する。

【構成】 複数のアノードとカソードを電解槽に交互に配置して電解精製を行う電解精製法において、カソード両面に流入する各電流を測定し、各電流が等しくなるようにカソードの位置をアノードに対して調整する。また、複数のアノードとカソードを電解槽に交互に配置して電解精製を行う電解精製法で用いる測定装置において、カソードの両側に等距離に配置されるプロープを有し、該プローブの各々は、一定間隔に配置された2本の参照電極を有し、2本の参照電極間の電位差を測定する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数のアノードとカソードを電解槽に交 互に配置して電解精製を行う電解精製法において、カソ ード両面に流入する各電流を測定し、各電流が等しくな るようにカソードの位置をアノードに対して調整するこ とを特徴とする電解精製法。

【請求項2】 請求項1記載の電解精製法において、前 記各電流の値は、それぞれ、2本の参照電極間の電位差 を測定することによって得られることを特徴とする電解 精製法。

【請求項3】 複数のアノードとカソードを電解槽に交 互に配置して電解精製を行う電解精製法で用いる測定装 **置において、カソードの両側に等距離に配置されるプロ** ープを有し、該プローブの各々は、一定間隔に配置され た2本の参照電極を有し、2本の参照電極間の電位差を 測定することを特徴とする測定裝置。

【簡求項4】 請求項3記載の測定装置において、前記 電位差からアソードに流入する電流値が換算によって得 られることを特徴とする測定装置。

【請求項5】 請求項3記載の測定装置において、2本 20 の参照電極は先端が電解液に露出するように包囲する包 囲体を有し、該包囲体は2本の参照電極の露出位置が水 平方向の高さが異なるように斜めに形成されていること を特徴とする測定装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、電解精製法および該電 解精製法で用いる測定装置に関する。

[0002]

【従来の技術】銅などの金属の従来の電解精製法におい ては、一定間隔をおいて2つの並列して配置したプスバ ー(電極)上に交互に並べられ、電解槽中浸せきした多 数のアノードとカソードに一定電流を並列に給電して行 う。プスパーは、一定間隔で絶縁部が設けられており、 アノードとカソードは、プスパーに載置されるとき、各 アノードの両端は、一方のプスパーの絶縁部と、他方の ブスバーの非絶縁部(導電部)に載置され、そして、各 **カソードの両端は、他方のブスバーの絶縁部と、一方の ブスパーの非絶縁部に載置されるので、電流は、各アノ** -ドから電解液を通って各カソードに流れる。これによ 40 銅などの金属の電解精製が行われる。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】並列した電極(プスパ -) に電流を流すことから、アノードとブスパーの導電 『の接点、カソードと(具体的には、カソードを支持す ,ためのクロスピームと) ブスパーの導電部の接点にお る抵抗のバラツキによって、特定のカソードに電流が れ過ぎることがある。この場合、電流の流入が多い力 ードの表面に粒、瘤などが生じ、外観評価の低下、不 物混入などの品質上の問題が生じる。 さらに カリー 50

ドの位置が隣接する2枚のアノードの位置に対して電気 的に中間に位置しなければ、そのカソードの両面への電 流の流れが不均一となる。

2

【0004】即ち、そのカソードの位置に隣接する2枚 のアノードの片方がカソードに電気的に近ければ、近い 方のアノードに対向するカソードの面に多くの電流が流 れ、粒、瘤が生じ、またショートの原因となる。

【0005】また、電解精製における種板電解工程な ど、1枚のカソードの両面の電着板を剥ぎ取る操業を行 う工程においては、両面の電着量が等しくなることが重 10 要である。

【0006】このような理由から、カソードの装入位置 を正しく管理することが、操業管理、品質管理上、重要 である。しかしながら、装入位置の調整作業は、作業者 の熟練によること以外に方法がなく、省力化上の大きな 問題となっていた。

【0007】また、並列した電極に電流を流すことか ら、特定のカソードに電流が流れすぎるとその流れ過ぎ たカソードの表面に粒、瘤などが生じ、外見評価の低 下、不純物混入などの品質上の問題が生じる。

【0008】特定のカソードに電流が流れ過ぎるのを防 止するためには、各カソードのクロスピームと電極の各 接点の接触状態を研磨等により良好に保つことが必要で ある。カソードに流れる電流は、カソードと接点の間に 分流器を挿入することによって、または、電流が流れる ことで生じる磁気量をガウスメータ等で測定することで 知ることできる。しかし、すべてのカソードのクロスピ ームと接点の間に分流器を挿入することは費用と手間が かかりすぎ、また操業上の障害となり、実用的でない。

また、ガウスメータは高価な上に、周囲の磁気の影響を 受け易いため誤差が大きく、精度的に非常に大きなパラ ツキしか発見できないという欠点がある。このように、 カソードに流れる電流はカソードの各面での電流値を知 ることが必要であるにもかかわらず、適当な電流測定装 置がないのが現状である。

【0009】したがって、本発明の第1の目的は、電解 精製を行うにあたり、カソードの装入位置のずれを検出 し、その検出に基づいて調整作業を容易に行うことがで きる電解精製法を提供することにある。

【0010】また、本発明の第2の目的は、電解精製を 行う際、複数のカソードのそれぞれのアノードに面した 2つの面に流れる電流値を容易に測定できる測定装置を 提供することにある。

[0011]

【課題を解決するための手段】前述の第1の目的を達成 するために、本発明は、複数のアノードとカソードを電 解楷に交互に配置して電解精製を行う電解精製法におい て、カソード両面に流入する各電流を測定し、各電流が 等しくなるようにカソードの位置をアノードに対して調

る。

【0012】前述の第2の目的を達成するために、本発 明は、複数のアノードとカソードを電解槽に交互に配置 して電解精製を行う電解精製法で用いる測定装置におい て、カソードの両側に等距離に配置されるプローブを有 し、該プローブの各々は、一定間隔に配置された2本の 参照電極を有し、2本の参照電極間の電位差を測定する ことを特徴とする測定装置を採用するものである。

[0013]

【作用】カソードは2枚のアノードの間に装入されるた 10 め、仮にカソードがアノードの中間(カソードの両面に 流入する電流が等しい中間位置)に装入されておらず、 偏った位置に装入されていれば、カソード1枚に流入す る電流値が通常の値であっても、片面の電流が高くな り、電着量が多くなりすぎたり、粒が発生することがあ る。

【0014】カソード表面の電位は電流による電位差と して現れる。このため、カソードの両面における電位を 測定し、両面の電位を比較することによって電流の差を 知ることができる。しかし、電位には、同時に添加剤の 影響による分極による影響も加わる。添加剤は経時変化 し易いため、電位としては不安定であると考えられる。

> ECRI=ECI+EA $I = (ECR1 - ECR2) / (d \cdot R)$

【0019】1式から解かるように、1式では、分極に よる電位差EAがある。分極による電位差は電流や電極 板の表面状態などで変動するため、この電位から電流を 正確に求めることはできない。一方、2式で示すよう に、2本の参照電極の電位の差を求めると、共通な分極 による電位差EAはう打ち消され、参照電極のカソード 30 からの位置の差による電位差(ECR1-ECR2)の みが残ることになる。

【0020】したがって、2本の参照電極の間隔dを一 定とした場合、電流値は液の比抵抗Rがわかると、電位 差から2式に基づく換算から求めることができる。ま た、比抵抗は、例えば、測定しようとする場所の電解液 を既知の一定電流で通電し、その時点の電位値を測定す ることで、容易に決定できる。

[0021]

【実施例】次に、図面を参照して、本発明の実施例を説 明する。最初に電解精製法に用いる測定装置に関して説 明する。本発明の電解精製法で用いるアノード、カソー ドおよび電位差(または電流)測定装置(以下単に測定 装置という場合もある)の配置を図1に示し、測定装置 の端子の構造を図2に示し、測定装置の主な電気回路プ ロックを図3に示す。

【0022】図1は本発明の電解精製法で用いる主要部 品であるアノード、カソードおよび測定装置の配置を示 す概略斜視図である。図1において、符号10は、アノ

*【0015】そこで、本発明においては、カソードの両 面の各々の電位測定に2本の参照電極を用い、参照電極 間の電位差を測定するものである。参照電極の間隔を一 定にすることにより、電位差は、そのまま電流差に変換 できる。

【0016】このため、参照電極を用いてカソードの両 面の電位差、即ち電流差を測定し、電流差がなくなるよ うな位置に、カソードの装入を調整するまたは位置を再 調整することによってカソードの両面の電着量をほぼ等 しくできる。電位差の測定は数が多い方が望ましく、カ ソードの位置のずれを確実に検出するためには、最低4 ケ所の測定が必要である。

【0017】さらに,参照電極を2本用いる理由を説明 すると、1つの参照電極とアノードあるいはカソードと の電位差(ECRi)、液抵抗(ECi)、アノードあ るいはカソード分極による電位差(EA)の間には、以 下の1式が成立し、また2本の参照電極間に流れる電流 (I)、その場合の各参照電極とアノードあるいはカソ ードとの電位差(E C R 1)および(E C R 2)、 2 本 の参照電極の間隔(d)、測定場所の液の比抵抗(R) の間には、以下の2式が成立する。

[0018]

(1)

20

• • • • (2)

びカソード12は、電解槽(図示せず)内に交互に複数 個配列されている。14は、カソード12を支持するク ロスピームを示す。 1.6 は、測定装置を概略的に示し、 この測定装置16は図2、図3を参照して詳細に後述す る。18は、プスパー24 (点線で示す) とアノードま たはカソードの接点を示す。即ち、2本のプスパー24 に対してアノード10と、カソード12を支持するクロ スピーム14が載置され交互に接点が配置されている。 なお、22は分流器である。このような構成は、測定装 置を除いて、従来と同様であるので、さらに詳しい説明 は省略する。

【0023】次に、図2を参照すると、測定装置16の 端子部分の詳細が示されている。測定装置16は、絶縁 性の例えばPVC製の支持板16aを有し、支持板16 aの中央には、カソード12(図1参照)と接触するた めの、具体的には、カソード12を支持するクロスピー ム14と接触するための接点16が設けられている。こ の接点16bからはカソード電位を電気回路に導くため のリード線16iが接続されている。なお、この実施例 では、カソードに対する測定装置のプローブの電位差を 測定するために、接点16bが設けられているが、これ に限定されるものではなく、例えば、アノードに対する 測定装置のプローブの電位差を測定するようにしてもよ い。なお、測定装置16全体は、接点16bを、カソー ドを支持するクロスビーム14の任意の位置で接触する ードを示し、12はカソードを示し、アノード10およ 50 ように、クロスピーム14に沿って移動できるものであ

る。また支持板16aの接点16bから等距離の支持板 16aの両端には、垂直方向に配列されたプロープが支 持されている。これらのプロープは左右対象であるの で、各構成部分は図面上同一の符号で示し、その一方だ けを以下に説明する。また、各プロープは、以下に説明 するように、それぞれ2本の参照電極を構成している。

【00.24】プローブは導電性の例えばステンレス製の中空パイプ16cとその下端に取付けられた絶縁性の例えばエポキシ樹脂先端部16dを有する。導電性の例えば銅製の線16eと16fが、これらの間隔が一定であるようにエポキシ樹脂内に埋め込まれており、そしてエポキシ樹脂の下端は斜めに形成されている。したがって、これらの導線16eと16fは、前述した2本の参照電極を構成し、また導線間の距離は前述した間隔dを表す。これらの導線16eと16fからそれそれシールド線16gと16hがエポキシ樹脂の中空パイプ16dとステンレス製の中空パイプ16cの内側を通して上方に導かれており、参照電極で得られた電位を電気回路に伝達するようになっている。なお、図面中の数字は、寸法を表す(単位:mm)。また、符号a~eは、電位測定箇所を示す。

【0025】次に、図3を参照すると、各電位測定箇所 から得られた電位を処理する電気回路プロックが示され ている。一方の2本の参照電極で測定された電位、即 ち、箇所aで測定された電位、箇所bで測定された電 位、他方の2本の参照電極で測定された電位、即ち、簡 所dで測定された電位、箇所eで測定された電位は、そ れぞれ、差動増幅器OP1~4の一方の端子に入力さ れ、箇所cで測定されたカソード電位は、差動増幅器O P1~4の一方の端子に入力されている。このため、各 差動増幅器OP1~4は、カソード電位に対する各測定 箇所で測定された電位の差(電位差)を出力する。差動 増幅器OP1とOP2の出力は差動増幅器OP5の入力 端子に入力される。このため、差動増幅器OP5の出力 として、一方のプローブで測定される2本の参照館極間 の電位差が得られる。同様に、差動増幅器OP6の出力 として、他方のプローブで測定される2本の参照電極間 の電位差が得られる。差動増幅器〇P5の出力と差動増 幅器〇P6の出力は差動増幅器〇P7の入力端子に入力 されているので、差動増幅器OP7の出力として、どち らのプローブで測定された電位差が大きいか、即ち、電 流値が大きいかが判別できる。

【0026】(実験例)次に、図4~図6を参照して、 測定装置に関して行った実験例について説明する。図4 は測定装置における電位と電流の校正を行う方法を説明 するための側面図であり、図5は、図4の測定装置おけ る電位と電流の校正に用いられたプローブの側面図であ り、図6は測定装置測定値と分流器測定値の関係を示す プラフである。

【0027】図5に示すように、測定装置のプロープ

は、直径1ミリの銅線を、2本の参照電極の間隔が一定となるようにそれらの先端部をエポキシ樹脂で埋め込み、研磨して電極先端部のみが液に接するように形成した。この場合、プローブの先端が水平であると、電解液の流れを妨げることによる影響や電極表面への気泡の付着、あるいは周囲のノイズを拾ってしまうことなどで電位が不安定となる。そこで、本発明の測定装置では、プローブの下端を斜めに形成した構造(傾けた構造)とすることで、前述の問題を解決した。斜めの面が向く方向は2本の参照電極との電位差を測定しようとするアノードあるいはカソードが存在する方向となる。例えば、カソードとの電位差を測定する場合には、カソードに象配電極の斜めの面が向くようにする。傾きの角度は、液の流れを乱さず、しかも参照電極の深さ方向の位置がずれ過ぎないようにすることが必要である。

【0028】プローブからの銅線は下端部以外の場所の磁場の影響を防止するためにシールド線などに接続し、電解液から保護するためにステンレス・塩ビなどのパイプに通されている。

20 【0029】次に、図4を参照すると、符号30は、小型の電解槽30を示し、32はウーターパスを示し、34は温度調節器を示し、40、42は電子電圧計を示し、44は定電流源を示し、46は電圧計を示す。

【0030】小型電解槽の大きさは、幅100mm、長さ150mm、深さ100mmであり、この中に測定しよとする場所と同じ組成の電解液を1リットル入れた。電極面積 40×50 mmの純銅圧延板を2枚入れ、アノードとカソードとした。液温は測定点と同じ(60°C)とした。

30 【0031】通電電流密度は、100~300A/m² に変化させた。所定の電流密度に設定後、電位が安定したら、カソードと2本の参照電極R1(16f、16h)、R2(16e、16g)間の電位をそれぞれ測定した。

【0032】電位差と電流密度の間には、この実験例の 場合には、以下の3式および表1に示す関係がある。

y=11.61x · · (3) (yは電流密度A/m²、xは電位差mV)

表 1

電流密度 電位差 0A/m² 0mV 100 6 200 14 300 28

【0033】なお、図4において、2本の参照電極間の電位差R1、R2は、電子電圧計40、42を用いて各参照電極のカソードに対する電位差を直接測定した後2本の参照電極間の電位差を算出した値と全く等しいことが見いだされた。したがって、電位の測定数を減らすことができる。即ち、各参照電極のカソードに対する電位

差を測定する代わりに、2本の参照電極間の電位差を測 定すればよいものである。

【0034】一般には、電位差計の入力インピーダンス には1010~1011才一ム程度のものが用いられる。し かしながら、本発明の測定装置では、106 オームの市 仮のテスタ (例えば、日置電気株式会社製3218型) を使用しても図4に示す測定装置で使用した電位差計 (北斗電工株式会社製HA-151型) での値と何ら変 っることなく、そのまま使用できることがわかった。

【0035】電解槽内に、縦930mm、横1030m 10 a、厚さ38mmの大きさのアノードを25枚をアノー ベーアノード間の距離が105mmになるように装入し 亡。また、縦1050mm、横1070mm、厚さ0. 'mmの銅カソード24枚をアノード間に装入した。電 『被は液温は60°C、銅45g/1 (リットル)、硫 ₹190g/1 (リットル) の組成の液とし、カソード 流密度250A/m²で通電した。

[0036] 図5に示すプローブ (2本の参照電極) を 本用意し、図1、図2に示すように、カソードの両側 :各プローブが位置するように挿入し、電位差を測定し 。測定位置はカソードとアノードの中央となるように た。 2 本の、プローブによるカソードの両面の電位差 平均した。同時にカソードと接点間に分流器を取付け ソードに流れる電流を測定した。

0037] この結果を図6に示す。図6では、横軸 、電位を3式により換算した電流値をとり、縦軸に分 器による電流値を取ったときの関係を示す。この場 . 電位を3式により換算した電流値をyとし、分流器 より測定したカソードの電流をxとすると、以下の4 が成立する。

=1.018x ... (4)

式からわかるように、電位差の測定によりカソード電 を測定することができることが確かめられた。

3038】次に、前述の測定装置を用いた本発明の電 青製法を説明する。 図1 に示すように配列された電解 りのアノードとカソード間に電力を供給して電解精製 **すう。しかし、電解精製中、従来の技術で述べたよう** カソードがアノードの間に電気的な中間位置にない うには、カソードの一方の面に多くの電流が流れるこ こなる。このような電流の不均衡が発生しているか否 40 :測定装置で測定する。測定装置では、例えば、差跡 器OP7の出力からカソードのどちらの面に多く電 \$流れているかを判別できる。この判別結果を基に、 ほ差がなくなるようにカソードの位置をアノードに対*

表 2

最大値(kg)

実施例 調整あり 16.51 比較例 調整なし 16.67

045]以下の表3にカソードの両面から剥ぎ取っ

*して調整する。この調整によって、カソードの各面に対 して流れる電流値を均衡させて良好な電解精製を行う。 なお、電流値の差の測定は、カソードに沿って少なくと も4か所ほどの測定を行い、最良の位置を求めるように することが望ましい。

【0039】 (実験例) 以下に本発明の電解精製法の実 験例を説明する。電解槽内に、縦930mm、横103 0 mm、厚さ38 mmの大きさのアノードを26 枚をア ノードーアノード間の距離が105mmになるように装 入した。また、縦1050mm、横1070mm、厚さ 3mmのステンレス(SUS304L)製力ソード25 枚をアノード間に装入した。電解液は液温は60°C、 銅48g/1(リットル)、硫酸160g/1(リット ル) の組成の液とし、カソード電流密度 2 5 0 A/m² で24時間通電した。添加剤はにかわ80g/電着量 t、チオ尿素60g/tとした。

【0040】カソードの装入は、人手で短絡のないよう に簡単な位置あわせをした後、通電を行った。通電2時 間後に各カソードとアノードとの間に測定装置を挿入 し、電位差を測定し、各カソードの電位差の平均値が-定になるようにカソードの接点を研磨した。それと同時 に、カソード両面での電位差が最小となるようにカソー ドの装入位置を調整した。

【0041】なお、電位の測定は、カソード中央部およ び両端から150mmの位置とし、上端から500mm の位置とした。測定装置としては、図2で示した構造の ものを用いた。なお、測定においては、電位差や電位差 の大小だけでなく、電位差と電流値の関係から電流値を 電位差から換算した(図3の回路の例えば差動増幅器O 30 P5、OP6の出力(電位差の値を出力)から換算し た)。

[0042] 24時間通電後に電解槽への給電を停止 し、カソードを引上げ、その両面に電着した電着板をは ぎ取り、単重を測定した。また、比較例として、実施例 と同一条件であるが、人手で短絡のないように、簡単に 位置合わせした後に、通電した。

【0043】通電2時間後に各カソードとアノードとの 電解槽に測定装置を挿入し、電位差を測定し、そのまま 調整することなく、24時間通電し、剥ぎ取り後単重を 測定した。

【0044】以下の表2にカソードあたりの電着型の変 化を示す。電流値を測定し、電流が低いカソードの接点 を研磨することにより、カソード電着量のばらつきが減 少した。

最小値(kg) ばらつき (σ)

13.93

0.69

11.54 1. 23

示すように、位置調整を実施することでカソード両面の 板単重の平均とばらつきを示す。また以下の表4に 50 単重比も位置調整により小さくなった。

表 3

最大値 (kg) 最小値 (kg) 平均 (kg) ばらつき (σ)

実施例 調整あり 9.06 6.57 7.82 0.596

比較例 調整なし 9.62 5.60 7.62 0.834

表 4

単重比ばらつき (σ)

実施例 調整あり 0.09

比較例 調整なし 0.15

【0046】上記のように電位差を測定することで、装入調整が確実に実施でき、電着量ばらつきが減少し、製 10品品質が向上することが確認できた。

[0047]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 電解槽内におけるカソード面上の電流を容易に測定でき る測定装置が得られ、また、その測定装置を電解精製法 に用いることによって、良好な電解精製結果が得られ る。

【図面の簡単な説明】

【図1】図1は、本発明の電解精製法で用いる主要部品であるアノード、カソードおよび測定装置の配置を示す 20 概略斜視図である。

【図2】図2は、測定装置の端子部分を拡大した示す断

面図である。

【図3】図3は、電気回路プロックを含めた測定装置全体を示す図である。

10

【図4】図4は測定装置における電位と電流の校正を行う方法を説明するための側面図である。

「図5」図5は、図4の測定装置おける電位と電流の校正に用いられたプローブの側面図である。

【図6】図6は測定装置測定値と分流器測定値の関係を示すグラフである。

【符号の説明】

10 アノード

12 カソード

14 クロスパー

16 測定装置

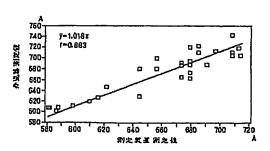
18 接点

2 2 分流器

24 プスパー

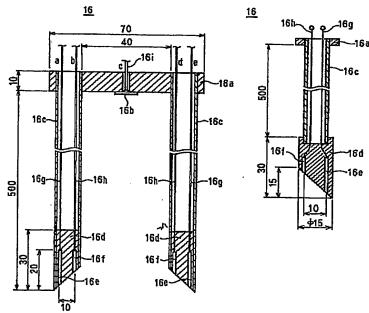
[図 1]

[図6]

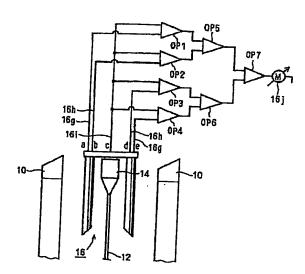


【図2】

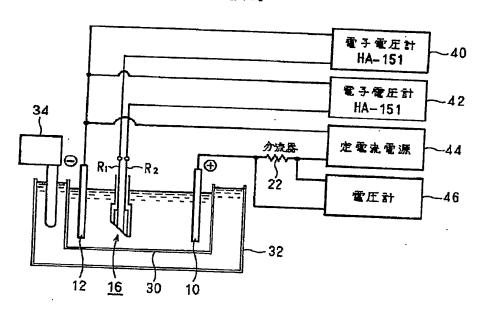
【図5】



[図3]



【図4】



۸,





PCT/EP03/07051 Atotech Deutschland GmbH 14 October 2004

5

25

30

Patent Claims:

- A device for monitoring an electrolytic process, comprising at least one anode and at least one cathode, at least one first reference electrode being disposed at the surface of the at least one anode and at least one second reference electrode being disposed at the surface of the at least one cathode, at least one voltmeter being respectively provided for measuring the electric voltages between the at least one anode and the at least one first reference electrode, between the at least one first and the at least one second reference electrode and between the at least one second reference electrode and the at least one cathode, wherein the cathode is a wafer or a chip carrier substrate.
- 2. The device according to claim 1, wherein the at least one reference electrode communicates through capillaries with the surface of the at least one anode or with the surface of the at least one cathode.
 - 3. The device according to claim 2, wherein means are provided by means of which electrolyte fluid is deliverable through the capillaries to the at least one reference electrode.
 - 4. The device according to one of the aforementioned claims, wherein the at least one anode and the at least one cathode are paralleled and oriented horizontally or tilted from horizontal.
 - 5. The device according to one of the aforementioned claims, wherein the anode is a metal plate.

10

15

20

25

30



2

- 6. A method of monitoring an electrolytic process in an electrolytic cell comprised of at least one anode and of at least one cathode, at least one first reference electrode being disposed at the surface of the at least one anode and at least one second reference electrode being disposed at the surface of the at least one cathode, at least one voltmeter being respectively provided for measuring the electric voltages between the at least one anode and the at least one first reference electrode, between the at least one first and the at least one second reference electrode and between the at least one second reference electrode and the at least one cathode, wherein the cathode is a wafer or a chip carrier substrate, said method involving the following method steps:
 - a) providing an electric current flow between the at least one anode and the at least one cathode,
 - b) concurrently measuring the respective electric voltages between
 - b1) the at least one anode and the at least one first reference electrode,
 - b2) between the at least one first and the at least one second reference electrode and
 - b3) between the at least one second reference electrode and the at least one cathode.
- 7. The method according to claim 6, wherein the at least one reference electrodes are brought into contact with the surface of the at least one anode or with the surface of the at least one cathode by way of capillaries.
- 8. The method according to claim 7, wherein electrolyte fluid is delivered through the capillaries to the at least one reference electrodes.
- 9. The method according to one of the claims 6 8, wherein the at least one anode and the at least one cathode are paralleled and oriented



3

horizontally or tilted from horizontal.

10. The method according to one of the claims 6-9, wherein the anode is a metal plate and wherein the metal is electrolytically deposited on the wafer or chip carrier substrate.